SOLID-STATE IMAGE SENSING DEVICE

Publication number: JP1220862 (A)

Publication date: 1989-09-04

Inventor(s):

YAZAKI MASATOSHI

Applicant(s):

SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international: H01L27/146; H01L27/14; H01L27/146; H01L27/14; (IPC1-7); H01L27/14

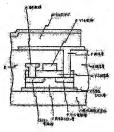
- European:

Application number: .IP19880046673 19880229

Priority number(s): JP19880046673 19880229

Abstract of JP 1220862 (A)

PURPOSE:To realize a solid-state image sensing device of high performance which is hard to be affected by radiation by providing a driving field effect transistor having a channel part composed of a silicon single crystal layer constituted on the surface of a part of a transparent insulative substrate built by using a polycrystalline silicon layer as seed crystal, forming an insulating layer, and arranging thereon a photo diode constituted of amorphous silicon layer. CONSTITUTION:On a transparent insulative substrate 1, a polycrystalline sillcon layer 2 is formed. Thereon, a field effect transistor is constituted of a semiconductor layer composed of a single crystal silicon layer 3, a source electrode part 4 and a drain electrode part 5 constituted by Impurity diffusion, a gate insulating film 6 composed of silicon dioxide, and a gate electrode 7.; On the transistor, a photo diode 10 composed of amorphous silicon is formed sandwiching an insulating layer 8. The diode 10 and one of the electrode parts joined to the channel part of the transistor are connected via a wiring layer 9.



Data supplied from the esp@cenet database -- Worldwide

(9) 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-220862

®Int. Cl. 4 H 01 L 27/14 織別記号 庁内整理番号 E-8122-5F ❸公開 平成1年(1989)9月4日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

の発明の名称 固体撮像素子

②特 願 昭63-46673

②出 頤 昭63(1988) 2月29日

@発 明 者 矢 崎 正 俊 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式 会社内

加出 顕 人 セイコーエブソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 最上 務 外1名

3. 発明の詳細な説明

1. 発明の名称

固体操像素子

2. 特許請求の範囲

ホトダイオードと駆動用の電界効果トランジス タからなる光電変換素子群を配置した固体損像素

多結晶シリコン暦を種類晶として構成された単結 晶シリコン暦よりなるチャンネル部を有する影動 用の電界効果トランジスタを設け、 は世界効果ト

用の電界効果トランジスタを設け、鉄電界効果ト ランジスタ上に絶縁層を有し、鉄絶器層上にアモ

ルファス・シリコン層からなるホトダイオードを 有し、 抜ホトダイオードと鉄電界効果トランジス

タのチャンネル部に接合する電極部の一つが、配 線層を介して連結することを特徴とする関係操像

亲子。

(産業上の利用分野)

本発明は、透明絶縁性基体上に、単結晶シリコン層よりなるチャンネル部を有する駆動用電界効

果トランジスタとアモルファス・シリコン層より なるホトダイオードを設けた固体機会主子に関す

るものである.

(従来の技術)

従来の単結晶シリコン層よりなるチャンネル部 を有する駆動用電界効果トランジスタを有する固 体操像業子は、特別関 6 2 - 5 8 5 4 9 分級に知

一歳されている。第3図に従来の固体操像素子の断 価図を示す。同図において、n形基板15の一主

表面にp形不純物拡散層16を設け、その上にそ

れぞれMOSトランジスタのソース電極器4とド レイン電極部5を構成するn形拡散層、ならびに

ゲート絶縁膜 6 を介してゲート電極 7 を配置して ある。前記 n 形拡散層 4 は P 形不純物拡散層 1 6

と共にホトダイオードを構成しており、このホト ダイオードの接合面の拡板側に、埋込層 1.7を設 けてある。4光電変換業子は帰舗絶疑側19および素子用分解機化側18によって絶絶分離されているが、前記埋込湯17は一方向に配列したネホトダイオードについて電気的に連結した線光電を表する。また、マトリリス状に配置された4光電を換業子の4系効果トランジスタの45ドレインとしての17形拡散層5は、4条例ごとに共適の信号配線 11に接続してある。

(発明が解決しようとする課題)

電界効果トランジスタ上に光道厳層を構成しない 限り、電界効果トランジスタのチャンネル値に光 動起電波が生ずるため電界効果トランジスタのス イッチング特性の悪化を招くことがあった。

をこで、本発明の固体操作素子は、基体内に複 数の不統物層を構成することなくプルーミング現 象やスミア現象を無くし、基体の同主変形からの の入計を可能とし、光道無層を構成すること く電界効果トランシスタの光動起電波の発生を さえ、放射線の影響を受けにくい高性能の固体操 常素子を実現することを目的としている。

(課題を解決するための手段)

このような目的を達成するために、未発明の回 休護業 子は、ホトダイオードと販売間の電圧 サトランジスからなる光電業子群を配置した 原 後 機 像 素 子において透明 総 性 选 体 上 の 一 処 表 画 上 に 多 結 品 シリコン 層 を 有 し、 抜 多 結 品 シリコン 層 屋 上 に 単 結 品 シリコン 層 を 経 射 品 と レ て 頃 成 さ れ た 単 熱 品 シリコン 層 を 経 射 品 と レ て ル 成 を す す る 取 角 川 の 電 界 熱 果 ト ランジスタを 設け、 該電

を起こし、精密な光電変換を不可能なものとする 課題を有していた。そこで、 n 形 拡板 1 5 に P 型 不純物拡散層16を構成し、その中間に接合容量 増大のための埋込み暦17を構成することにより ホトダイオード部の飽和電荷蓄積容量を増やし、 ブルーミング現象を抑制する対策がとられていた が、拡散層構成のための工程数も多く、不純物拡 **数の基板内バラツキによるホトダイオード特性の** バラツキを生じやすかった。また、このような複 雑な構造によるホトダイオードを構成しても、依 然として拡板内を通じて生じるフォトダイオード 間での電荷移動や、基板内に侵入したα線などの 放射線によって生じる拡板内電荷のフォトダイオ ード館や電界効果トランジスタへの混入を無くす ることはできなかった。さらに、シリコン基板は 不透明なため、入射光線のホトダイオード部への 入射方向は、基板の一方の表面だけに限定されて しまっていた。そのうえ同一基板面にフォトダイ オード部と世界効果トランジスタを構成するため に世界効果トランジスタにも光が入射しやすく、

界効果トランジスタ上に絶縁層を有し、放映線形 上にアモルファス・シリコン層からなるホトダイ オードを有し、はホトダイオードと域電界効果ト ランジスタのチャンネル部に被合する電極器の一 つが、配線器を介して運動することを特徴とする。

(実施例)

以下、実施料を用いて未発明による個体機業素因 子を解析を表現する。第1回は、未発明でよる。 同回におして、通明動を対して、大変を 同回におして、通明動を性高が、大変を する。この多数品とりコンプ層である。 明をは、大変を がある。この多数品とりコンプ層である。 明を がある。この多数品とりコンプ層である。 明を がある。 のたに、電子効果トラシジズのの形で、 での入れを のの大変で、電子が のの大変で、 ののた。 のの大変で、 ののた。 ののより、 ののた。 ののより、 ののなのなので、 ののより、 ののなのなので、 ののより、 ののより、 ののなので、 のので、 のので 游体層と不純物拡散により構成されたソース電極 部4とドレイン電板部5、さらには二酸化シリコ ンよりなるゲート絶縁膜6とゲート電極7が設け られ電界効果トランジスタが構成されている。こ の電界効果トランジスタは、その側面及び上部を 終録歴8(たとえば二酸化シリコンや窒化シリコ ン)に囲まれ、その下部を多結晶シリコン層2を 狭んで透明絶縁性蓝体1で囲む完全案子分離形に なっているために、導電性のシリコン基板内に作 られた電界効果トランジスタに生じるような放射 線や光励起によって基板内の電荷が電界効果トラ ンジスタ内に侵入するような現象は起きない。そ のため、特に、光励起電流の発生量は小さく、本 発明の電界効果トランジスタはシリコン基板内に 構成された電界効果トランジスタと比べるとお以 下に光励起電波を抑えることが可能である。前記 電界効果トランジスタ上には、絶縁層8を狭んで アモルファス・シリコン懸からなるフォトダイオ - ド10が設けられる。このアモルファス・シリ コンよりなるフォトダイオード10は、いわゆる

pin 積階形のもので、その積層の順番は光の入 射面を透明絶縁性基体1のどちらの主表面に設定 するかによって異なっており、pin積層とni p結婚の相方が可能である。さらに、アモルファ ス・シリコン層からなるフォトダイオード10は 、光散変換の役割を果たすと共に、光の入射面が 済明絶録作基体のフォトダイオード10と電界効 果トランジスタの技層した面に設定された際には 、世界効果トランジスタへ入射する光を遮蔽する 役割をも有している。前配のように、光の入射面 が、關体機像素子の積層面と逆の面にあるときに は、種結晶となる多結晶シリコン層2が光遮蔽層 となり、また、結婚面側に入射面が設定されたと きには光電変換器となるアモルファス・シリコン 恐からなるフォトダイオード10が光道厳層とな る。このため、光の入射面を透明絶縁性基体1の いずれの主表面に設定しても光遮蔽層が基本的構 成要素により実現でき、特に光遮蔽層を作り込ま なくとも光入射による電界効果トランジスタの特 性劣化を抑制することが可能である。さらに、フ

ォトダイオード10は、絶級暦8上にあり隣接の フォトダイオードと離れて存在する。したがっ て、導電性のシリコン基体内に設けられたフォト ダイオード間に生じる過剰電荷の混入によるブル ーミングも発生せず、フォトダイオード10の外 からの電荷の異常挽入は生じない。また、第2図 にみられるようにフォトダイオード10を構成す るアモルファス・シリコンのフォトダイオードの 盛度13の光波長依存性は、人間の視感度12に 近く、単結晶シリコンのフォトダイオードの視感 度14に比べ、人間の視感度に対するずれをもた ない。このため、シリコン基板中に構成されたフ ォトダイオードの感度を、人間の視感度 12 に合 わせるためには長被長光の光をカットしてフォト ダイオードに光を入射することが必要で、赤外カ ットフィルターを要する。ところが、本発明のフ ォトダイオード10は、アモルファス・シリコン 層より形成されるために、赤外カットフィルター を付けなくとも人間の視感腹12に合致した光電 変換が容易に可能である。さらに、多結晶シリコ

(発明の効果)

子によれば、以下に示す効果を有する。
1 ・ 機構品となる多結品シリコン層を存在した
ことにより、シリコン活版り、安価で大面積な 連列
総経性基体上に関係機像業子を多数かることが可
他で、低コストと関係機像業子が実現できる。
2 ・ 通明能機性基体を使用することにより、光
の入射面を主二英面の相方のいずれの面に設定す

ることが可能で、ホトダイオードの構造の任意性

以上説明したように、木発明による個体操像素

特開平1-220862 (4)

も広げることができる。

3 ・・多結品シリコン暦とフォトダイオードが電 界効果トランジスタに入射する光を遮蔽するた め、光温を間を作り込む必要がなく、電界効果ト ランジスタの光電波による特性劣化を抑励するこ とができる。

4・・アモルファス・シリコン層より構成される
フォトダイオードは、隣接するフォトダイオード
と分離されているためにフォトダイオードの超和 審積電荷より過剰に発生した電荷が需電層を流れ ではなっているというこのため、精密な光電変換 が可能である。

5 ・ 理界効果トランジスタは絶縁物で開まれた 素子分離形状となっているために、世界効果トラ ンジスタへの開西からの具常電荷進入は生じな い。このため、駆動用電界効果トランジスタの正 確な動作が可能である。

6・・シリコン基板を使う場合のように不純物拡 数によるウエルを構成する必要もなく、拡散の錆 笛なコントロール、拡散工程も不要で、鉱散民のバラツキによる素子特性のバラツキも抑制することが可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1団は木処明の国体機像素子の一定施料を示す要解新植図、第2団は、アモルファスシリコン 及び単結晶シリコンよりなるフォトダイオードの 相対極度と人間の視断度の彼長依存性を示す団、 第3団は、従来の関体機像素子を示す断値図である。

1・・・透明絶縁性基体

2・・・多結晶シリコン層
 3・・・単結晶シリコン層

4・・・ソース電板部

5・・・ドレイン電極部

6・・・ゲート絶経膜

7・・・ゲート電極

9・・・配線層

10・・・フォトダイオード

11・・・信号配線

12・・・人間の視感度

13・・・アモルファス・シリコンのフォトダイオードの感度

1 4 ・・・単結晶シリコンのフォトダイオード の感度

15・・・ n 形基板

16・・・P形不純物拡散層

1 7 ・・・埋込層

18・・・楽子間分離酸化膜

19・・・層間絶縁膜

2. 为于为代本计 文 下一、實施 2. 然准等 2. 经线管 2. 外线的 3. 为为2. 净 4. 为 2. 数据 4. 数 4. & 4.

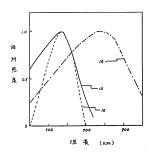
第1区

・ |人 セイコーエブソン## 今#

代理人 弁理士 最 上 務(他1名

以.上

特開平1-220862 (5)



,7

第 2 图

第3浬